



IIEEJ(画像電子学会) 第1回 VMA セミナー “最近のコミック、イラスト制作に求められる画像処理”

第1回 VMA セミナーとして、コミック、イラストなどで利用されている画像処理技術を取り上げ、国内で広く使われているコミック、イラスト制作ツールの開発者をお迎えしてツール開発者からクリエイターへの思いを伝えていただきます。さらに関連分野の市場動向調査および大学での研究・教育の専門家をお迎えして、コミック、イラストのクリエイターを対象にした掘り下げたご講演をいただきます。第2回セミナーは、2013年の年度末に開催を予定しています。

開催日時 2013年10月25日(金) 13:30~17:00

開催場所 東京ビッグサイト 703 会議室
〒135-0063 東京都江東区有明 3-21-1
アクセス：ゆりかもめ『国際展示場正門』駅下車 徒歩約3分
所在地地図 <http://www.bigsight.jp/general/access/index.html> を参照

主催 / 協賛 主催：一般社団法人 画像電子学会 VMA 研究会
協賛：株式会社 セルシス

参加費 (資料代を含む) 会員およびアソシエイト：4,000円 非会員：10,000円
当日の受付にてアソシエイトになっていただきますと、入会・年会費(1,000円)を含む計5,000円で参加できます。

I. プログラム

13:30-13:35	開会挨拶	小町 裕史 (VMA 研究会委員長)
13:35-15:05	1, コミック制作ツール ComicStudio の開発者による解説	川上 陽介 (セルシス)
15:15-16:05	2, デジタルコミックの市場動向と今後	高木 利弘 (クリエイション)
16:05-16:55	3, マンガのデジタル化と表現の変化	木寺 良一 (東京工芸大学マンガ学科)
16:55-17:00	閉会挨拶	深見 拓史 (VMA 研究会副委員長)

上記の講師および講演表題は、多少変更される可能性があります。

II. 参加申し込み

事前参加申し込みは、画像電子学会のウェブページ (<https://www.iieej.org/trans/kenaf.htm>) から行って下さい。当日も受け付けています。



3D オブジェクトのプレビュー画像を表示



プレビュー画像を見にして作成

コミケの作品づくりに役立っ!!